



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Yoichiro NUMASAWA et al.

Serial No. NEW

: Attn: APPLICATION BRANCH

Filed August 22, 2003

: Attorney Docket No. 2003-1164A

METHOD FOR FORMING AN OXYGEN-
OR NITROGEN-TERMINATED SILICON
NANOCRYSTALLINE STRUCTURE AND
AN OXYGEN- OR NITROGEN-TERMINATED
SILICON NANOCRYSTALLINE
STRUCTURE FORMED BY THE METHOD

THE COMMISSIONER IS AUTHORIZED
TO CHARGE ANY DEFICIENCY IN THE
FEE FOR THIS PAPER TO DEPOSIT
ACCOUNT NO. 23-0975.

CLAIM OF PRIORITY UNDER 35 U.S.C. § 119

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Applicants in the above-entitled application hereby claim the date of priority under the International Convention of Japanese Patent Application No. 2002-243342, filed August 23, 2002, as acknowledged in the Declaration of this application.

A certified copy of said Japanese Patent Application is submitted herewith.

Respectfully submitted,

Yoichiro NUMASAWA et al.

By:

Michael R. Davis
Registration No. 25,134
Attorney for Applicants

MRD/pth
Washington, D.C. 20006-1021
Telephone (202) 721-8200
Facsimile (202) 721-8250
August 22, 2003

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office

出願年月日

Date of Application:

2002年 8月23日

出願番号

Application Number:

特願2002-243342

ST.10/C]:

[JP2002-243342]

出願人

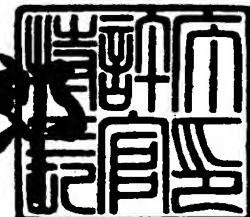
Applicant(s):

アネルバ株式会社

2003年 6月16日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田 信一



出証番号 出証特2003-3046935

【書類名】 特許願
【整理番号】 3648P2002
【提出日】 平成14年 8月23日
【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿
【国際特許分類】 C09K 11/00
【発明者】
【住所又は居所】 東京都府中市四谷5丁目8番1号 アネルバ株式会社内
【氏名】 沼沢 陽一郎
【発明者】
【住所又は居所】 東京都府中市四谷5丁目8番1号 アネルバ株式会社内
【氏名】 村尾 幸信
【特許出願人】
【識別番号】 000227294
【氏名又は名称】 アネルバ株式会社
【代理人】
【識別番号】 100059281
【弁理士】
【氏名又は名称】 鈴木 正次
【電話番号】 03-3353-3407
【連絡先】 FAX 03-3359-8340
【選任した代理人】
【識別番号】 100108947
【弁理士】
【氏名又は名称】 涌井 謙一
【手数料の表示】
【予納台帳番号】 011589
【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
【物件名】 明細書 1